

高 増 潔

高増潔氏は、長きにわたって精密計測の研究に従事し、独自に提案した知的ナノ計測の概念に基づき、不確かさの評価手法および自己校正手法を光ナノメートル計測に適用することにより、知的計測技術、ナノメートル標準計測技術およびナノメートル加工計測技術をものづくりへ展開する新しい研究領域を切り開いてきました。その研究成果は、学会のみならず産業界でも高く評価されています。

同氏の研究成果に対する高い評価として、新しい機構の精度評価および校正法の開発（2007年）、ナノ光造形法に関する研究（2008年）、超解像光学式欠陥計測の研究（2009年）、微小機能性構造を一括で光造型する手法に関する研究（2019年）により、精密工学会論文賞を受賞されています。2012年には、鏡面形状のナノメートル計測手法の研究により精密工学会沼田記念論文賞を受賞されています。また、多くの国際会議で、精密計測に関する研究により受賞されています。

工業標準化においては、三次元測定機を代表する測定機器、寸法公差および幾何公差に関わるISO規格およびJIS規格の標準開発に取り組み、多くのJIS規格の原案作成委員会委員長、ISOの国内対策委員長、日本工業標準調査会専門委員会委員長などを歴任され、2016年に工業標準化への功績により経済産業大臣賞を受賞されています。

また、高増潔氏は精密工学会副会長、精密工学会フェロー、知的ナノ計測専門委員会委員長などを歴任され、精密工学会の発展にも大きな役割を果たしてこられました。精密工学会の国際化に対しては、専門委員会として、ISMTH 2007 (International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, 仙台)、ISMQC 2010 (International Symposium on Measurement and Quality Control, 大阪) および LMPMI 2014 (Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry, 筑波) などの国際会議を主催いたしました。さらに、ASPEN (Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology) の設立に参画し、その後も理事としてアジアにおける精密工学の連携に尽力されています。

以上のとおり、高増潔氏は精密計測分野における基礎的な研究開発と基礎技術の実用化を展開され、学術的、工業的および教育的な発展に貢献されてこられ、精密工学に関する功績は極めて大きいといえます。



略 歴

- 1982年 東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻博士課程修了（工学博士）
- 1982年 東京大学工学部助手（精密機械工学科）
- 1985年 東京電機大学工学部講師（1987年助教授）（精密機械工学科）
- 1993年 東京大学大学院工学系研究科助教授（精密機械工学専攻）
- 2001年 東京大学大学院工学系研究科教授（精密工学専攻）（～現在）
精密工学会フェロー（2013年度）